

MVPプロセス装置を用いた超高速DLC成膜技術と超高速膜剥離技術

マッチングの要望

希望マッチング先	① プラズマ処理分野 (DLC成膜分野)	② 表面被膜メーカー
マッチングメリット	・超高速プラズマ処理による処理時間短縮、多品種小ロット処理品の歩留まり向上	・再被膜に行う除膜工程時間の短縮および剥離剤等による基材へのダメージの減少

開発したのはこんな技術です

- ・MVP(Microwave-sheath Voltage combination Plasma)法は基材に対して負の電圧を印加することで、基材表面にマイクロ波伝搬を可能にし、基材近傍に高密度プラズマの生成する新しいプラズマ発生法。
- ・この発生方法を用いたプラズマCVD法で、DLCの超高速成膜(120 μ m/h以上)を達成している。

これまでの導入実績は？

- ・MVPプロセス装置、MVP-DLC成膜装置の試作機の製造実績
- ・各種プラズマ装置(CVD、エッチング装置など)の開発・設計・製造実績

★ おすすめのポイント

- ① 本超高速処理装置を用いることで、多品種小ロット処理品の歩留まりが大幅に向上
- ② 大型装置と比較して装置導入コストが1/4
- ③ DLC成膜の超高速成膜(120 μ m/h以上)が可能
- ④ プラズマを用いることで基材へのダメージの少ない工具表面被膜の除膜が可能



この技術を開発したのは…

企業名	株式会社片桐エンジニアリング		
所在地	神奈川県横浜市	資本金	10百万円
設立	1991年7月	従業員数	41名

お問い合わせボタン

<https://www.yano.co.jp/contact/contact.php/consulting>